DELPHION

View: INPADOC | Jump to: Top

RESEARCH

My Account

PRODUCTS

Go to: Derwent

INSIDE DELPHION

Search: Quick/Number Boolean Advanced Der

The Delphion Integrated View

Buy Now: PDF | File History | Other choices

Tools: Add to Work File: Create new Work

☑ Ema

₽Title: JP2002235036A2: ANTIREFLECTION LAMINATE

영 Derwent Title: Anti-reflection laminate applicable to transparent glass or plastic substrate useful on display, comprises silicon alkoxide and fluorine containing

silicone compound [Derwent Record]

JP Japan

ଟ Kind: A2 Document Laid open to Public inspection !

YOSHIHARA TOSHIAKI: OHATA KOICHI:

OKUBO TORU:

JP2001000034947

TOPPAN PRINTING CO LTD

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed: 2002-08-23 / 2001-02-13

> Number:

@IPC Code:

Advanced: B05D 5/06; B32B 7/02; B32B 27/00; C09D 5/32; C09D 175/14; C09D 183/02; C09D 183/08; G02B 1/11;

Core: G02B 1/10: more..

IPC-7: B05D 5/06; B32B 7/02; B32B 27/00; C09D 5/32; C09D 175/14;

C09D 183/02; C09D 183/08; G02B 1/11;

Priority Number: 2001-02-13 JP2001000034947

PAbstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an antireflection laminate having low refractive index, practically sufficient physical strength and excellent stainproofness, productivity, or the like, and producible at a low cost.

SOLUTION: The objective antireflection laminate has a lowrefractive layer obtained by coating at least one surface of a transparent substrate such as a plastic material or glass with a lowrefractive coating agent composed mainly of fluorine-containing silicon compounds expressed by the general formula (A) Si(OR)4 (R is an alkyl) and the general formula (B) CF3-(CF2)p-(CH)n-Si (OR)3 ((p) is an integer of 0≤p≤8; (n) is an integer of n<5; and R

is an alkyl) or their hydrolyzed products.

COPYRIGHT: (C)2002, JPO

None

CHEMABS 137(12)170685S CHEMABS 137(12)170685S DERABS Info: C2002-670235 DERABS C2002-670235









Nominate this for the Gallery...

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-235036 (P2002-235036A)

(43)公開日 平成14年8月23日(2002.8.23)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FI		テーマコード(参考)	
C 0 9 D 183/02		C 0 9 D 183/02		2K009	
B 0 5 D 5/06		B05D 5/06	F	4D075	
B32B 7/02	103	B32B 7/02	103	4F100	
27/00	101	27/00	101	4 J 0 3 8	
C09D 5/32		C 0 9 D 5/32			
	審查請求	未請求 請求項の数	8 OL (全 7 頁)	最終頁に続く	
(21)出順番号	特顧2001-34947(P2001-34947)	11-7	003193 6印刷株式会社		
(22) 出顧日	平成13年2月13日(2001.2.13)	東京都台東区台東1丁目5番1号			
		(72)発明者 吉房	後昭		
		東京	都台東区台東1丁目5	番1号 凸版印	
		路(核	式会社内		
		(72)発明者 大炬	浩一		
		坡	都台東区台東1丁目8	番1号 凸版印	
		別核	村式会社内		
		(72)発明者 大夕	(保 選		
			都台東区台東1丁目5	番1号 凸版印	
		Bit	式会社内		
				最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 反射防止積層体

(57)【要約】

【課題】本発明は、低屈折率と実用上十分な物理的強度 を有し、しかも安価で、防汚性、生産性等に優れた反射 防止積層体を提供することを目的とする。

【解決手段】プラスチックやガラス等の透明基材の少な くとも方面に、下記一般式(A)と一般式(B)で表さ れるフッ素を有ケイ素化合物、およびその加水分解物と を主成分とする低阻折率コーティング剤を値布形成され た低阻折率層を設けたことを特徴とする反射防止積層体 でる。

一般式 (A)

Si(OR)4

(ただし、Rはアルキル基)で表されるSiアルコキシド、およびその加水分解物 一般式(B) CF₃-(CF₂)₅-(CH)_n-Si

-MXX (B

(OR)₃

(ただし、pは0≤p≤8の整数、nはn<5の整数、</p>

Rはアルキル基)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 プラスチックやガラス等の透明基材の少な くとも片面に、

> 一般式(B) CF3-(CF2),-(CH),-Si (OR) 3

(ただし、pは0≤p≤8の整数、nはn<5の整数、 Rはアルキル基)で表されるフッ素含有ケイ素化合物、 およびその加水分解物とを主成分とする低屈折率コーテ ィング剤を塗布形成された低屋折率層を設けたことを特 徴とする反射防止積層体。

【請求項2】請求項1記載の透明基材と低屋折率層の間 にハードコート層を設けたことを特徴とする反射防止精 層体。

【請求項3】前記ハードコート層が、紫外線、電子線等 の電離放射線硬化樹脂からなることを特徴とする請求項 2記載の反射防止積層体。

【請求項4】前記電離放射線硬化樹脂が、分子中にビニ ル基、アクリロイル基、メタクリロイル基等の重合可能 な不飽和結合を少なくとも3個以上有するアクリル系化 合物を主成分としたことを特徴とする請求項3記載の反 射防止精層体.

【請求項5】前記電離放射線硬化樹脂が、アクリル系化 合物の少なくとも1種が分子中にウレタン結合を有する ウレタンアクリレートからなることを特徴とする請求項 4記載の反射防止積層体。

【請求項6】前記ハードコート層を形成するウレタンア クリレートが分子中に2個以上のイソシナート基を有す る化合物と該イソシア基と反応するOH基を有しアクリ ロイル基を2個以上有するアクリル化合物との反応生成 物であることを特徴とする請求項5記載の反射防止精層 体。

【請求項7】前記電離放射線硬化樹脂が、平均分子量6 00~5000の範囲であることを特徴とする請求項6 記載の反射防止積層体。

【請求項8】前記電離放射線硬化樹脂が、生成分子中の アクロイル基が4個以上の多官能ウレタンアクリル化合 物であることを特徴とする請求項6記載の反射防止精層

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ガラスやプラスチ ック等の透明基材などに塗工した、低屈折率で、かつ物 理的強度に優れた光学多層膜が形成された反射防止精層 体に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、ガラスやプラスチックなどの透明 基材に、酸化チタンや酸化ケイ素などの無機酸化物を蒸 着法あるいはスパッタ法などのドライコーティングによ って薄膜を形成して反射防止膜などの光干渉による光学 多層膜を形成する方法が知られている。しかし、このよ うなドライコーティングプロセスでは装置が高価で、成 一般式(A) Si(OR)4

(ただし、Rはアルキル基)で表されるS1アルコキシ ド、およびその加水分解物と、

膜速度が遅く、生産性が高くないなどの課題を有してい る。特に、ディスプレイの反射防止膜などの最外層に使 用される形態においては、表面の汚れ防止、容易拭き取 り性いわゆる防汚性能が必要であるが、これらの機能を 付与するために別途ウェットあるいはドライブロセスに てフッ素含有ケイ素化合物などの保護膜を設ける必要が あり、工程が煩雑でより高価なものとなってしまうなど の課題もある。

【0003】これに対して、金属アルコキシドなどを出 発組成とし、基材に塗工して光学多層膜を形成する方法 が知られている。この高屈折率材料としては、TiやZ rなどのアルコキシドが用いられる。また、低屋折塞材 料としては、Si系アルコキシドあるいはSiアルコキ シドの一部をエポキシ基やアルキル基など他の有機置換 基に置き換えた有機ケイ素化合物、いわゆるシランカッ プリング剤などを用い、さらに防汚成分としてフッ素含 有ケイ素化合物を添加されてなる塗膜を設ける方法が提 案されている(特開平9-208898号など).

【0004】しかし、これらの塗膜は塗膜形成時の乾燥 ・重合に高温、長時間を必要とするため生産性に問題が ある。また、この途膜は、ある程度の低い屈折率と、あ る程度の防汚性を付与するとはできるが、 硬度や耐燃傷 性、基材との密着性などの物理的強度を満足することが できない。上記途膜は、最外層に使用されるため、強度 が不十分では実用に耐えることができないといった欠点 を有している。

【0005】上記に述べたような問題点を解決するため に、塗膜を形成する組成物としてケイ素アルコキシドを 出発物質としたシリカゾルと反応性有機ケイ素化合物 (シランカップリング剤や末端に反応基を有するジメチ ルシリコーンなど)との複合材料などが提案されている (特開平9-220791号など).

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら のSiO。系複合機組成物からなる途膜に十分な物性を 得ようとすると加熱に長時間を要する。例えば、途膜 が、アクリロイル基などの重合性不飽和基を含有する有 機ケイ素化合物からなる場合、いずれもアクリロイル基 が1個ないし2個の単官能あるいは2官能性の化合物で あり、電子線による重合しても高い架橋密度が得られな い。上記組成物からなる塗膜の硬度や耐擦傷性などの物 理的強度を向上させようとすると、上記塗膜成分中にシ リカ成分以外の成分、例えば、アクリル系化合物を複合 させて、アクリル成分比率を高くする必要がある。ま た、ケイ素アルコキシドを出発物質とした塗膜は、アク リル成分比率を高くなると光学特性を決定するSi系な とのアルコキシドを出発組成とするシリカ成分の体積比 が減少し、低肥折率化をはかることができないという欠 派を有する。前記組成物からなる途膜では、促肥折率化 と硬度や耐熔傷性、密着性などの物理的強度が両立し、 かつ指数などの汚れを簡単に拭き取ることができる反射 防止積層体以見出されていない。

【0007】そこで、本発明は、上配課題を解決するためになされたものであって、低屈折率と実用上十分な物理的強度を有し、しかも安価で、防汚性、生産性等に優

一般式(B) \mathbb{CF}_3 -(\mathbb{CF}_2) (ただし、 \mathbb{P} は0 \leq \mathbb{P} \leq \mathbb{N} \otimes \mathbb{N}

微とする反射防止積層体でる。 【0009】請求項2に係る発明は、請求項1記載の透 明基材と低超折率層の間にハードコート層を設けたこと を特徴とする反射防止積層体である。

【0010】請求項3に係る発明は、請求項2記載の反射防止積層体において、前記ハードコート層が、紫外 銀子線等の電離放射線硬化樹脂からなることを特徴 とする。

【0011】請求項4に係る発明は、請求卯3記載の反 射防止積層体において、前記電離放射線硬化固脂が、分 子中にビニル基、アクリロイル基、メタクリロイル基等 の重合可能な不飽和結合を少なくとも3個以上有するア クリル系化合物を主成分としたことを特徴とする。 【0012】請求項5に係る発明は、請求項4記載の反

射防止積層体において、前記電離放射線硬化樹脂が、ア クリル系化合物の少なくとも1種が分子中にウレタン結 合を有するウレタンアクリレートからなることを特徴と

一般式(B) CF₉ - (CF₂)_p - (CH)_n-S1 (OR)₂ (ただし、pは0≤p≤8の整数、nはn<5の整数、 ができ、低屈折率化と高が 汚機能も有する精解体を持 (たてルキル基。)で表されるアッ素含有ケイ素化合 (大型・カールを)である。

Rはアルキル基、)で表されるフッ素含有ケイ素化合物、およびその加水が解物しを主成分とする低屈折率の ゾルゲルコーティング剤で形成される途膜で、ハードコート層と低屈折率層との密着性を高めることができるも のである。

【0017】本発明の低田が専開は、SI系成分が低間 下車成分として機能するものではあるが、パーフルオロ アルキル基の導入により強膜内部のシロキヤンネットワ ークを寸断することで塗膜内部に分子レベルの隙間を形 成し、膜密度を低下させ、低屈折率化(1.44以下)を とはかることができるものであり、特定の加水分解方法 で調整することで架線構造をある程度寸断しても、分子 レバイブリッド構造を呈しているものである。塗膜の密 度は低下しても充分な架構構造を有しているので、充分 な強度を発揮でき、短いで成り、最低機能性も良好であっ 、健来の促屈折率組成物の欠点を本幅に必要すること れた反射防止積層体を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するために、請求項1に係る発明は、プラスチックやガラス等の透明基材の少なくとも片面に、

の透明基材の少なくとも片面に、 一般式(A) Si(OR)。

(ただし、Rはアルキル基)で表されるSiアルコキシド、およびその加水分解物と、

CF3-(CF2)p-(CH)n-Si (OR)3

する。

[0013] 請求項もに係る参明は、請求項 5記載の页 財防止機構体において、前記ハードコート層を形成する ウレタンアクリレートが分子中に 2個以上のイソシナー ト基を有する化合物と該イソシア基と反応する〇日基を 有しアクリロイル基を 2個以上有するアクリル化合物と の反応生販がごることを考慮とする。

【0014】請求項7に係る発明は、請求項6記載の反射防止積層体において、前記電離放射線硬化樹脂が、平均分子量600~5000の範囲であることを特徴とす

【0015】請求項8に係る発明は、請求項6記載の反 射防止積層体において、前部電離放射線硬化樹脂が、生 成分子中のアクロイル基が4個以上の多官能ウレタンア クリル化合物であることを特徴とする。

【0016】<作用>本発明によれば、ハードコート層をウレタン結合を有する電離放射線硬化樹脂とし、低屈 折率層を

一般式(A) Si(OR)₄

(ただし、Rはアルキル基)で表せられるSiアルコキ シド、およびその加水分解物と

ができ、低屈折率化と高強度化の両立可能でなおかつ防 汚機能も有する積層体を提供するものである。

【0018】 【発明の実施の形態】本発明の一実施例を詳細に説明す

G (0019]本発明の反射防止機層体はウレクン結合を 有する無外線、放射線等の電磁放射線吸化側筋からなる ハードコト層とゾルゲル系低圧折率組成物を基材に順 が鉱工し、ハードコト層。低起折率層を形成し、反射 防止機層体を得るものである。本発明における低配折率 展示・トラエトキシシランなどのSiアルコキシ・ フッ素含有ケイ条化合物およびその加水分解物を主成分 とする組成物からなるものであり、これを基材に塗工 し、加熱乾燥し、塗膜を形成可能とするものであり、 観成物中にさらに長鏡RF並と等入し腹密度を削御す ることで、膜の屈折率を低下させるものである。

【0020】低屈折率層のコーティング材料に含まれる 各成分について以下に詳述する。本発明において用いら れる、Siアルコキシドは、

一般式(A) Si(OR)4

(ただし、Rはアルキル基) で表されるものであり、テー般式(B) CF。- (CF

(ただし、pは0≤p≤8の整数、nはn<5の整数、 R:アルキル基、)で表されるもので、トリフルオロブ ロビルトリメトキシシラン、トリデカフルオロオクチル トリメトキシシランなどが例示され、 mが8より大きき なると均質な膜が形成できなくなるため不適である。一 般式 (A) のSiアルコキシドと一般式 (B) のフッ素 含有ケイ素化合物との比率がモル比で(A)/(B)= 1.0/0.01~1.0/0.2とすることで低屈折 率化と強度を両立することができ、防汚性能も発現でき 好適であるが、さらに好ましくは1.0/0.03~1 /0.1の範囲である。フッ素含有ケイ素化合物のSi アルコキシドに対するモル比が、0、01以下では低屈 折率化が図れず、また防汚機能も充分ではない。また、 フッ素含有ケイ素化合物のSiアルコキシドに対するモ ル比が、0.2より過剰になると低屈折率化と防汚は良 好であるが、Rf基の増加によりシロキサン架橋が充分 得られず強度が著しく低下してしまい不適である。有機 ケイ素化合物は、上記に例示した化合物に例示に限定さ れるものでなく、2種以上組み合わせても何ら差し支え なく、Siアルコキシドとフッ素含有ケイ素化合物を併 用してあれば良い。

【0021】有機ケイ素化合物は、コーティング組成物 中にp-トルエンスルホン酸などの有機酸触媒を含有さ せることで、塗工後に大気中の水分でもって加水分解反 応させて塗膜形成しても良いし、また予め水 (塩酸など の触媒を含む)を添加し、加水分解反応させたものを用 いることもできる。特に、下地との密着性を重視する場 合、塩酸を触媒として通常用いられる加水分解水 (通 常、アルコキシド1mo1に対し、水2~4mo1)よ りも多い状態で反応させる。すなわち、一般式(A)の Siアルコキシドと一般式(B)のRf-Siとを合わ サた全シラン化合物をO.1N~5.0Nの塩酸によっ て加水分解を行い、加水分解の際の塩酸中の水が、全シ ラン化合物:水のモル比で1:5~1:10mo1/m o 1の比率とすることで密着良好で均一な透明途離が形 成することができる。塩酸の規定度が低い場合、水の比 率が高すぎる場合(1:10以上)は、その加水分反応 溶液を基材にコーティングしたとき、斑点状のハジキや 欠陥が生じ易く、水の比率が低い(1:5以下)場合 は、塗膜は均一であるが、下地のハードコート層との密 着がやや低下するため望ましくない。また各成分を別々 に加水分解反応させた後、混合させても良いが、反応さ せる前に混合して、同時に共加水分解させた方が均質な 重合体ができるため望ましい。

【0022】上記のゾルゲル系組成物の組み合わせは、 一般に公知ではあるが、本発明の積層体は単なる組み合 トラメトキシシラン、テトラエトキシシランなどが例示 される。フッ素含有ケイ素化合物は、

 CF_3 - $(CF_2)_p$ - $(CH)_n$ -Si $(OR)_3$

わせではなく、下地のウレタン結合とマトリックスであ るコート組成物の無機のネットワークとの相溶性、親和 性が高く、単に有機健脂からなる層上に積層するより密 著性が高い塗膜が得られる材料系である。そして、上記 調整方法のようにコントロールされた加水分解条件によって密著性が答とに向上する。

【0023】ハードコート層は、透明プラスチック基材 表面の硬度を向上させ、鉛筆等の荷重のかかる引っ損き による傷を防止し、また透明基材の風曲による反射防止 層のクッラク発生を抑制することができ、反射防止積層 体の機械的強度が改善できるものであり、通常、分子中 にビニル基、アクリロイル基、メタクリロイル基などの 重合可能な不能和結合を少なくとも3個以上を有するア リル系化合物を主成分とする電能放射線硬化制脂が用 いられる。本発明におけるハードコート層は、アクリル 化合物の少なくとも1種が分子中にウレタン結合を有す 。 いわゆるウレタンアクリレートからなる電能放射線 硬化制脂を用いることで、ハードコートとしての性能を 発揮しつつ、低圧折率層との高い密着性も発現させるも のである。

【0024】ウレタン結合を有する多官能アクリル化合 物とは、その分子中にビニル基でメタ クルロイル基など重合可能なの不能和結合を少なくとも 3個以上有し、かつウレタン結合を有するものであっ て、例えば、ジイソシアネートとアクリルを含すがリオ ルルとのプレボリマーなどがあげられ、特に限度される

ールとのアレボリマーなどかあげられ、特に限定される ものではないが、なかでも0日基合有多官能とフマーで あるペンタエリスリトールトリアクリレート (PET A)とヘキサメチレンジイソシアネート (HDI)など のジイソシアネートとの反応生成である多官能アクリル 化合物で、平均分子量600~5000のものであれば 好適である。ウレタン/アクリルの混合比は態限中にお ける固形分比で30wt%以上が好適であるが、30% より少ない。同形分比では効果が少ない。

[0025]参管能ビアーは、1種類のみを使用して 6良いし、2種類以上を併用しても食い。また、必要で 有れば単管能モノマーと併用して共産含せることもで きる、ハードコート層は、透明基材と服所率が同等もし くは近似していることがより好ましい。態度は2μm以 上おればある程度十分な機度となるが、透明性、塗工精 度、取り扱いから4~7μmの範囲が好ましい。前記ハ ードコート層に、平均粒子径が0.01の3μmの無機 あるいは有機物微粒子を混合分散させる。または、表面 形状を凹凸させることで、一般的にアンチグレアと呼ば れるが拡充性処理を抽すことができる。上部域的子は対象 が関するれば料に限まされるものではないが、低級には対象が 料が好ましく、酸化珪素が安定性、耐熱性等の点からで 好ましい。

【0026】ハードコート層を張外線照射によって硬化 する際には、ラジカル重合開始剤を添加すると好適であ る。ラジカル重合開始剤として、ペンゾインメチルエー テルなどのベンゾインエーテル系開始剤、アセトフェノ 、2、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェルケトン などのアセトフェノン系開始剤、ベンゾフェノンなどの ベンゾフェノン系開始剤などが挙げられるが、特に限定 されるものではない。

【0027】ハードコート層を形成するコーティング組成物は、上述した各成分をいくつか組み合わせて加えることができ、さらに、執触を損なわない範囲で、分散 利、安定化剤、粘度調整剤、着色剤など公知の添加剤を加えることもできる。

【0028】コーティング組成物の塗布方法には、通常 用いられる。ディッピング法、ロールコティング法、ス クリーン印刷法、スプレー法など従来公知の手段が用い られる。整限の厚さは、目的の光学設計にあわせて、液 の濃度や陸工量によって適宜選択調整することができ

【0029】ハードコート層上に、コーティング溶液を 塗工する前に、コート層に予め表面処理を施すことによ り、ハードコート層と低屈折率層との密着性を向上させ ることができる。前処理としては、アルカリ処理法、酸 処理、コロナ処理法、大気圧グロー放電プラズマ法等を 挙げることができるが、なかでもアルカリ処理が有効 で、使用するアルカリ水溶液としては、例えば、水酸化 ナトリウム、水酸化カリウム等の水溶液、あるいはそれ らの水溶液に、更にアルコール等の各種有機溶媒を加え たアルカリ水溶液等を挙げることができる。アルカリ処 理の条件は、例えば、水酸化ナトリウム水溶液を用いた 場合、0、1~10Nの濃度の水溶液として使用するこ とが望ましく、更には、1~2Nの濃度が望ましい。ま た、アルカリ水溶液の温度は、0~100℃、好ましく は、20~80℃である。アルカリ処理の時間は、0. 01~10時間、好ましくは、0.1~1時間である。 【0030】ハードコート層に、予めアルカリ処理を施 すことでハードコート表面の粗度(凸凹状態)を制御 し、コート層表面にナノ凸凹構造を形成することによ り、より低屈折率層との密着を向上させるものである。 本発明における表面粗さとは、表面粗さの定義は、JI S-B0601に準拠するものではあるが、原子間力顕 微鏡などによって測定される微小領域、微小スケールに おける表面粗さのことである。算術平均粗さRa、10 点平均粗さの計算はJIS-B0601の定義に準じ

【0031】本発明における反射防止積層体は、可視領域の光学干渉を利用した反射防止層であるため、積層される塗膜の膜厚が100nm~200nm程度であり、

途職が連載した順を形成できかつ、光鉛紅の影響がでない程度の表面相さである必要がある。凸凹の差が大きすぎたり、凸凹の現底が高すると積層体のヘイズが増加し、さらに強度の低下を引き起こすので適当ではない。また、平滑着さる表面では3・ドコート層と低低折率層との密着強度向上が期待できない。以上のことから、表面相されるが18・2か10 nmが好流である。

[0032]

【実施例】以下、本発明の反射防止積層体の具体的な実 施例について説明する。

【0033】 <実練例1~4~80μm厚のトリアセナルセルロース(TAC)フィルムを基材として、下記に「したハードコート組成物として、ウレタン結合を有するアクリル系染外線硬化樹脂組成物を表面に施工して、紫外線硬化とせてハードコート層(5μm)を設けた基材を作製した。このハードコート層(5μm)を設けた基材を作製した。このハードコート層の表面をアルカリ処理を施し、下記に示した低銀炉率コーティング組成物として、A1、A2を用いて、バーコーターにより塗布して、乾燥機で120℃一5m1 n 乾燥後、光学販厚(n 由一版が基と3 速度調整をして低照外電管系成し、各種評価用の反射防止積層体を得た。その反射防止積層体を表下配に示けた評価方法に基づいて評価した結果を表した示す。

【0034】ここで、低照所率コーティング組成物として、A1の組成物を塗工したものを実施例1、A2の組成物を塗工したものを実施例2とした。また、ハードコート層の表面をアルカリ処理を接していないハードコート層に、低圧所率コーティング組成物として、A1の組成物を塗工したものを実施例4とした。一方、比較例として、ウンタン組合を含まないハードコート組成物として、ペンタエリスリトールリアクリレートのみを用いてハードコート層を形成し、そのコート層をアルカリ処理を施し、低圧所率コーティング組成物として、A1の組成物を塗工したものを大阪例1として、A1の組成物を塗工したものを大阪例1として、A1の組成物を塗工したものを大阪例1として、A1の組成物を塗工したものを大阪例1として、A1の組成物を塗工したものを大阪例1として、A1の組成物を塗工したものを大阪例1として、A1の組成物を塗工したものを大阪例1として、A1の組成物を塗工したものを大阪例1として、A1の組成物を塗工したものを大阪例1とした。

[0035] ベハードコート組成物・市豚のウレタンア クリレート (ヘキサンメチレンジイソシアネートとペン タエリスリトールトリアクリレートの反応生成物)を EK溶剤にて希釈NV50%溶液。柴外線硬化用開始剤 として、アセトフェノン系開始剤を重合成分に対して2 %添加した。

【0036】〈低屈折率コーティング組成物〉

(A1): デトラメトキシシラン1molにトリデカフ ルオロオクチルトリメトキシシラン0.1molになる ように所定難混合し、混合物1molに対して0.3N の塩酸3molと固形分換算で10%になるようにイソ プロピルアルコールを混合し、室温で2時間撹拌反応さ せたて基本組成1を見かり (A2): テトラメトキシシラン1 molにリデカフルオロオクチルトリメトキシシラン0.1 molになるように所定産業点と、混合物1 molに対して0.3 Nの塩酸7 molと固形分換算で10%になるようにイソプロピルアルコールを混合し、塗温で2時間質料反応させたて基本組み2を得た。

【0037】<評価方法>

- (1)表面粗さ:原子間力顕微鏡AFM(SPI3700;セイコー電子)を用い走査範囲□5μmにて測定した。
- (2)光学特性:分光光度計により入射角5で550nm における反射率を測定した。
- (3)密着性:塗料一般試験法JIS-K5400のクロスカット密着試験方法に準じて塗膜の残存数にて評価した。
- (4) 鉛筆硬度: 徐料一撥試験法JIS-K5400の

鉛筆引っかき値試験方法に準じて塗膜の擦り傷にて評価 した。

- (5) 耐擦傷試験:スチールウール#0000により、 250g/cm2の荷重で往復5回擦傷試験を実施、目 視による傷の外観を検査した。評価は、婚なし(◎)、 かるく傷あり(○)、かなり傷つく(△)、若しく傷つ く(×)の4段階評価を行った。
- (6)指紋拭き取り性:強膜表面に指紋を付着させ、ティッシュペーパーにて拭き取り性を目視で検査した。評価は、容易に拭き取れる(○)、拭き取れる(△)、拭き取れる(△)、拭き取れる(△)、対き取れない(×)の3段階評価を行った。
- (7)接触角:塗膜表面に水滴をのせ、水滴と表面の接 触角を測定した。測定には協和界面科学(株)製の接触 角計を用いた。
- [0038]

【表1】

項目		実施例1	実施例 2	実施例3	実施例 4	比較例1
HC層*1)	組成	かか系	外外系	がか茶	かか系	弁が外系
	アルカリ処理	有り	有り	なし	なし	有り
L層 * 2)	親成	A1	A 2	A1	A 2	A 1
表面相さ	(Rz nm) (Ra nm)	30	30	1 1 0,5	1 1 0.5	22
反射率 (%)		1.4	1.6	1,4	1.6	1.4
密着性		95	100	90	95	30
鉛筆視度		3 H	3Н	3 H	2 H	2 H
耐象条性		0	0	Δ	0	×
指紋拭き取り性		0	0	0	0	Δ
接触角		106	105	106	105	105

(注) *1) ハードコート層 *2) 低層折率層

【0039】表1に示すように、いずれも反射率が低く、目的の低展が率層を得ることができたが、本売明の反射防止機構体におけるウレシ系ハードコート組成物からなるハードコート層の強限は、密着性、硬度、耐緩低性、助汚性なら優れるが、それに対して、比較例での反射防止機層体のハードコート層の強限は、前端係性や密着性など強度面列反射防止機構体において、ハードコート層表面のブルカリ処理(実施例1および2)のほうが密着強度に優れ、またコーティング組成物の加水分解条件で、水のモル比が多い、2を用いた系(実施例2)のほうが密着性、計様格性も優れている。

【発明の効果】以上述べたように、本発明により、特定 組成のハードコート組成物とブルゲル系低語が率トーテー イング組成物とを組合せたことで、ハードコート層と低 脱折率層との密着強度に優九、しかも低屈折率という光 学特性と実用上十分な物理が速度を有する反射防止裁層 に充分に関えられた。本発明の反射防止機層体は、通循な環境 に充分に関えられるもので、防汚性に優れているので取 り扱い易く、反射防止限として、ディスアレイの前面に 好適に使用される。また、本発明の反射防止機層体は コーティング方式によって製造することができるので、 総米の蒸着方式などと比較して、装置コストも比較的安 値で、生産速度も10倍以上で、大量生産ができること から、安確な及射防止機層体が得られる。

!(7) 002-235036 (P2002-!36

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

CO9D 175/14 183/08 CO9D 175/14 183/08 G 0 2 B 1/10

Α

G02B 1/11 Fターム(参考) 2K009 AA04 AA15 BB02 BB11 BB28

CC24 CC26 CC35 CC42 DD02

DD05 DD06 EE05 4D075 CA02 CA13 CA34 CA47 CB02

DA04 DA06 DB13 DB31 DC24 EA07 EA21 EA43 EB02 EB19

EB22 EB38 EB52 EB56

4F100 AGOOA AJO6A AKO1A AKO1C AK25C AK25K AK51C AK51K AK52B AL06C AR00C BA03

BAO7 BA10A BA10B GB41 JA07C JB14C JK06 JK12C

JN06 JN18 JN18B YY00C

4J038 DL021 DL072 FA111 FA281 GA01 JC31 JC32 MA14 NA05 NA19 PA17 PC03 PC08